(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-51566 (P2003-51566A)

(43)公開日 平成15年2月21日(2003.2.21)

(51) Int.Cl.7

識別記号

ΡI

テーマコート*(参考)

H01L 23/12

301

HO1L 23/12

301C

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願2001-239061(P2001-239061)

(22)出顧日

平成13年8月7日(2001.8.7)

(71)出題人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72)発明者 木村 俊二

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 佐野 荣一

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(74)代理人 100075753

弁理士 和泉 良彦 (外1名)

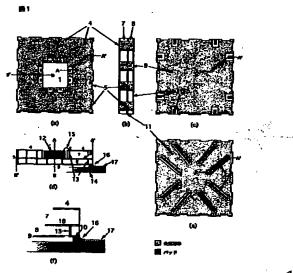
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 リードレスチップキャリア

(57)【要約】

【課題】優れた高周波特性を有するリードレスチップキャリアを提供すること。

【解決手段】誘電体材料7と8とが積層され、誘電体材料7の上面には接地導体4があり、誘電体材料7にはキャビティー1が設けられ、キャビティー1開口部周辺の誘電体材料7の上面には任意の数のパッド2があり、誘電体材料7と8との層間には接地導体11と層間伝送線路18とがあり、誘電体材料8の下面には接地導体9とパッド10とがあり、誘電体材料7及び8の内部には導体間接続用スルーホール13があることを特徴とするリードレスチップキャリアを構成する。集積回路12と伝送線路17との間の高周波電力の授受は、ボンディングワイヤ15、パッド2、スルーホール13、層間伝送線路18、パッド10及び導電性接合材16を介して行われる。



ーキャピティー、2ーパッド、4一般地場体、

ーメタライズされたキャスタレーション(微地響体)、

7 一朝地仲封邦(上居)、8 …僧地体材料(下層)、9 一般地部体、

10~パッド、11~影響等体、12~集製団路、13~スルーホール、

17…プリント基板上の保護機構、18…層間保護線路

Ret

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】多層に積層された誘電体材料から成り、該 誘電体材料の最上層にキャビティーを有し、前記誘電体 材料の最上層上面、最下層下面及び少なくとも1つの層 間にそれぞれ金属導体層を有し、前記最上層上面の金属 導体層の前記キャビティー開口部周辺に任意の数のバッ ドを有し、前記最下層下面の金属導体層外周部に任意の 数のパッドを有するリードレスチップキャリアにおい て、前記キャビティー開口部周辺のパッドと前記最下層 下面の金属導体層外周部のパッドとを伝送線路と前記誘 10 電体材料内のスルーホールとを用いて接続し、前記伝送 線路の一部または全てを前記層間の金属導体層に配する ことを特徴とするリードレスチップキャリア。

【請求項2】請求項1に記載のリードレスチップキャリ アにおいて、前記伝送線路に対する接地導体を前記金属 導体層の少なくとも1層に有し、前記接地導体間がスル ーホールもしくはメタライズされたキャスタレーション により接続されたことを特徴とするリードレスチップキ ャリア。

【請求項3】請求項1に記載のリードレスチップキャリ 20 アにおいて、前記伝送線路の少なくとも一部直上の前記 誘電体材料を取り除いたことを特徴とするリードレスチ ップキャリア。

【請求項4】請求項1、請求項2または請求項3に記載 のリードレスチップキャリアにおいて、気密封止用の蓋 を取り付ける構造を有することを特徴とするリードレス チップキャリア。

【発明の詳細な説明】

[0001]

ャリアに関し、特に、高周波用リードレスチップキャリ アに関する。

[0002]

【従来の技術】図6に、従来の2層の誘電体材料から成 る典型的なリードレスチップキャリアを示す。図中、 (a) はリードレスチップキャリアの上面図、(b) は 側面図、(c)は下面図、(d)は断面図(側面)、

(e)は層間金属導体層、(f)はプリント基板との接 続部(拡大図)を示す。 なお、 (d) 及び (f) は、リーニー・【0009】 図6に示すように、集積回路 12等からア ードレスチップキャリアがプリント基板上に実装されて 40 いる状態を示している。

【0003】図6において、誘電体材料(上層)7と誘 電体材料(下層)8とが積層され、誘電体材料7の上面 には伝送線路3と接地導体4とがあり、誘電体材料7に はキャビティー1が設けられ、キャビティー1開口部周 辺の誘電体材料7の上面には任意の数のパッド2があ り、誘電体材料7と誘電体材料8との層間には接地導体 11があり、誘電体材料8の下面には接地導体9とパッ ド10とがあり、誘電体材料7及び8の内部には導体間 接続のためのスルーホール13があり、誘電体材料7及 50

び8の側壁面には、接地導体となるメタライズされたキ ャスタレーション5と、伝送線路となるメタライズされ たキャスタレーション6とがある。

【0004】このように構成されたリードレスチップキ ャリアのキャビティー1内に回路素子、たとえば集積回 路12が装着され、集積回路12とパッド2との間は、 たとえば、ボンディングワイヤ15で接続される。 パッ ド10は、ハンダ等の導電性接合材16によって、電気 配線を有する基板たとえばプリント基板14上の伝送線 路17と接続され、これによって、リードレスチップキ ャリア全体がプリント基板14上に固定される。

【0005】 このように、従来のリードレスチップキャ リアはセラミック等の誘電体材料7及び8を用いた2層 の積層構造をもち、上層の上面、層間、下層の下面に金 展導体層(伝送線路3、接地導体4、11及び9等で構 成される)をもつ。各層の導体は必要に応じてスルーホ ール13で接続される。また、積層構造側面に、必要に 応じてメタライズされたキャスタレーション5及び6等 をもち、これによって、リードレスチップキャリアの導 体層間接続を可能としている。

【0006】リードレスチップキャリアはプリント基板 等との接続部にリードをもたないため、従来のリード付 きパッケージと比べて小型化を実現できるというメリッ トがある。

【0007】しかしながら、プリント基板等との接続は 底面部のパッド (図6において、パッド10) で行うた め、集積回路等が実装されている上面から底面部のパッ ドまでの接続構造としてスルーホール (図6において、 スルーホール13等) やメタライズされたキャスタレー 【発明の属する技術分野】本発明はリードレスチップキ 30 ション(図6において、キャスタレーション5及び6 等)等が必要となる。

> 【0008】これまで、信号線路の導体層間接続には、 主にメタライズされたキャスタレーションが用いられて きた。これは配線構造を単純化し製作コストを低く抑え られるほか、接地導体に比べて幅の狭い伝送線路にスル ーホールを使用した場合に、スルーホールの位置ズレや 誘電体層の貼り合わせ時に生じるズレにより接続不良が 生じる危険性を回避することができるためである。

リント基板14等への配線経路は以下のようになる。す なわち、キャビティー1に実装される集積回路12等の 入出力パッドはボンディングワイヤ15によりパッド2 に接続され、伝送線路3を介してキャスタレーション6 に接続される。キャスタレーション6はリードレスチッ プキャリアの側面を伝って底面のパッド10へ接続さ れ、パッド10は導電性接合材16によりプリント基板 14上に形成されている伝送線路17へ接続される。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】リードレスチップキャ リアは高周波集積回路等を実装する場合には以下のよう な課題があった。

【0011】図6(f)に示すように伝送線路17との接続部には導電性接合材16が用いられるが、接続部の物理的強度や信頼性を確保するためには一般にパッド10の面積が一定以上必要である。しかしながら、従来の構造において、キャスタレーション6とパッド10の接続部からパッド10が伸びている方向(図6の(d)、(f)における左方向)は、伝送線路17が引き出されている方向(同右方向)と逆方向であるため、パッド10の大きさが大きければ大きいほど高周波信号に対して

オープンスタブとして作用してしまい、リードレスチップキャリアの高周波特性を劣化させてしまうという問題

【0012】また、一般に、ボンディングワイヤ15は高周波特性を劣化させるため、ボンディングワイヤ15の長さを最短化するために集積回路12と誘電体材料7の厚みはほぼ等しく設計される。このため集積回路12の厚みが厚い場合誘電体材料7の厚みも厚くなってしまい、誘電体材料7内部での電磁界の共振周波数の低下から伝送線路3の高周波特性が劣化するという問題があっ 20た。

【0013】本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、優れた高周波特性を有するリードレスチップキャリアを提供することを目的とするものである。

[0014]

があった。

【課題を解決するための手段】上記を達成するために、本発明においては、請求項1に記載したように、多層に積層された誘電体材料から成り、該誘電体材料の最上層にキャビティーを有し、前記誘電体材料の最上層上面、最下層下面及び少なくとも1つの層間にそれぞれ金属等 30 体層を有し、前記最上層上面の金属導体層の前記キャビティー開口部周辺に任意の数のバッドを有し、前記最下層下面の金属導体層外周部に任意の数のパッドを有するリードレスチップキャリアにおいて、前記キャビティー開口部周辺のパッドと前記最下層下面の金属導体層外周部のパッドとを伝送線路と前記誘電体材料内のスルーホールとを用いて接続し、前記伝送線路の一部または全てを前記層間の金属導体層に配することを特徴とするリードレスチップキャリアを構成する。

【0015】また、本発明においては、請求項2に記載 40 したように、請求項1に記載のリードレスチップキャリアにおいて、前記伝送線路に対する接地導体を前記金属導体層の少なくとも1層に有し、前記接地導体間がスルーホールもしくはメタライズされたキャスタレーションにより接続されたことを特徴とするリードレスチップキャリアを構成する。

【0016】また、本発明においては、請求項3に記載したように、請求項1に記載のリードレスチップキャリアにおいて、前記伝送線路の少なくとも一部直上の前記誘電体材料を取り除いたことを特徴とするリードレスチ 50

ップキャリアを構成する。

【0017】また、本発明においては、請求項4に記載したように、請求項1、請求項2または請求項3に記載のリードレスチップキャリアにおいて、気密封止用の蓋を取り付ける構造を有することを特徴とするリードレスチップキャリアを構成する。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明の目的は、リードレスチップキャリアの伝送線路を誘電体層間に設け、伝送線路と 10 パッドをスルーホールによって接続することにより、上層の誘電体材料の厚みの影響を抑え、従来構造においてプリント基板等との接続部に生じるオープンスタブ構造を回避し、リードレスチップキャリアの高周波特性を改善することによって達成される。

【0019】本発明では、従来に比べて伝送線路の高周 波特性が改善され、プリント基板等との接続部にオープ ンスタブ構造を生じないため、高周波特性の良好なリー ドレスチップキャリアを実現できる。

[0020]

0 【実施例】以下、本発明の実施例として、セラミック等の誘電体材料が2層から成る場合を示す。

【0021】(実施例1)図1は本発明の第1の実施例を示す図である。図中、(a)はリードレスチップキャリアの上面図、(b)は側面図、(c)は下面図、

- (d)は断面図(傾面)、(e)は層間金属導体層、
- (f)はプリント基板との接続部(拡大図)を示す。なお、(d)及び(f)は、リードレスチップキャリアが 実装されている状態を示している。

【0022】図1において、誘電体材料(上層)7と誘 電体材料 (下層) 8とが積層され、誘電体材料7の上面 には接地導体4があり、誘電体材料7にはキャビティー 1が設けられ、キャビティー1開口部周辺の誘電体材料 7の上面には任意の数のパッド2があり、誘電体材料7 と誘電体材料8との層間には接地導体11と層間伝送線 路18とがあり、誘電体材料8の下面には接地導体9と パッド10とがあり、パッド10は該下面外周部に配置 され、誘電体材料7及び8の内部には導体間接続のため のスルーホール13があり、誘電体材料7及び8の側壁 面には接地導体となるメタライズされたキャスタレーシ ョン5がある。この場合に、パッド2及び接地導体4は 請求項1に記載の最上層上面の金属導体層を構成し、接 地導体11及び層間伝送線路18は請求項1に記載の層 間の金属導体層を構成し、接地導体9及びパッド10は 請求項1に記載の最下層下面の金属導体層を構成してい る。

【0023】このように構成されたリードレスチップキャリアのキャビティー1内に回路素子、たとえば集積回路12が装着され、集積回路12の入出力用パッドとパッド2との間は、たとえば、ボンディングワイヤ15で接続される。パッド10は、ハング等の導電性接合材1

6によって、電気配線を有する基板たとえばプリント基 板14 Lの伝送線路17と接続され、これによって、リ ードレスチップキャリア全体がプリント基板14上に固 定される。

【0024】本実施例が、図6に示された従来例と大き く異なる点は、層間伝送線路18を有することにある。 本実施例においては、集積回路12と伝送線路17との 間の高周波電力の投受は、ボンディングワイヤ15、パ ッド2、スルーホール13、層間伝送線路18、パッド 10及び導電性接合材16を介して行われる。これによ 10 り、スルーホール13とパッド10との接続部からパッ ド10が伸びている方向(図1の(d)、(f)における 右方向)と伝送線路17が引き出されている方向とが同 方向となるため、パッド10がオープンスタブとして作 用することはない。また、層間伝送線路18に対する電 磁界の共振周波数を誘電材料8の厚みで調整できるた め、集積回路12の厚みが厚く誘電体材料7が厚くなっ てしまった場合にも、誘電材料8を薄く設計することに より高周波特性の劣化を生じさせなくすることができ る。

【0025】 当然のことながら、従来例においては必要 であった、伝送線路としてのメタライズされたキャスタ レーションは不要となる。これは、以下の実施例におい ても同じである。

【0026】(実施例2)図2は本発明第2の実施例を 示す図である。図中、(a)はリードレスチップキャリ アの上面図、(b)は側面図、(c)は下面図、(d) は断面図 (側面) 、 (e) は層間金属導体層を示す。図 中の符号1、2、4、5、7~18は図1と同様のもの を示す。ただし、本実施例においては、誘電体材料7の 30 上面に、図6に示した従来例と同様に、伝送線路3を配 している。

【0027】本実施例はパッド数の多いリードレスチッ プキャリアで、パッド2と層間伝送線路18を接続する スルーホール13の間隔が狭くなり、スルーホール間隔 のルールを満たせない場合に有効である。 図2から明ら かなように、伝送線路の一部を伝送線路3として上層上 面に配置し、十分なスルーホール間隔をとってから層間 伝送線路18へ接続する。伝送線路3の特性は良好では ないため、第1の実施例ほどの効果は期待できないが、 従来のリードレスチップキャリアに比べて良好な高周波 特性を得ることができる。この場合に、接地導体4、9 及び11が伝送線路3または18に対する接地導体とな っている。この場合に、接地導体4、9及び11相互間 の接続はメタライズされたキャスタレーション5及びス ルーホール13によって行われている。

【0028】(実施例3)図3は本発明第3の実施例を 示す図である。図中、(a)はリードレスチップキャリ アの上面図、(b)は側面図、(c)は下面図、(d) は斯面図(側面)、(e)は層間金属導体層を示す。図 50 【0036】また、以上の実施例では誘電体材料が2層

中の符号は図1と同様のものを示す。

【0029】本実施例は、本発明第1の実施例の層間伝 送線路18の上部に存在する誘電体材料7を取り除いた もので、第1の実施例と同様の効果を得ることができ る。上部の誘電体が取り除かれたことにより層間伝送線 路18の実効誘電率が低下するため、層間伝送線路18 の電気長を短く設計したい場合や層間伝送線路18の特 性インピーダンスを高インピーダンスに設計したい場合 に有効である。

【0030】(実施例4)図4は本発明第4の実施例を 示す図である。 図中、 (a) はリードレスチップキャリ アの上面図、(b)は側面図、(c)は下面図、(d) は断面図 (側面) 、(e) は層間金属導体層を示す。図 中の符号は図2と同様のものを示す。本実施例は本発明 第2の実施例において、第3の実施例と同様に層間伝送 線路18上部の誘電体を取り除いたものに相当し、第2 の実施例に対し第3の実施例と同様の効果が得られる。 【0031】(実施例5)図5は本発明第5の実施例を 示す図である。図中、(a)はリードレスチップキャリ 20 アの上面図、(b)は側面図、(c)は下面図、(d) は断面図(側面)、(e)は層間金属導体層、(f)は シールリング、(g)は金属蓋を示す。図中の符号1、 2、4、5、7~18は図1と同様のものを示し、さら に、19は蓋支持用誘電体層、20はシールリング、2 1は金属蓋を、それぞれ示す。

【0032】蓋支持用誘電体層19及びシールリング2 0は請求項4に記載の気密封止用の蓋を取り付ける構造 を構成し、この構造と金属蓋20とにより、リードレス チップキャリアを気密封止することができる。図5にお いては、メタライズされたキャスタレーション5により 各接地導体層とシールリング20、金属蓋21が接続さ れている例を示したが、シールリング20、金属蓋21 は電気的に接地されていなくとも構わない。

【0033】図5においては、便宜上、本発明の第1の 実施例に蓋21を付けた構造を示したが、第2~4の実 施例に同様の構造を付加しても、第5の実施例と同様の 効果が得られる。

【0034】図1~図5では便宜上、伝送線路の本数が 8本のリードレスチップキャリアを示したが、伝送線路 の本数は任意である。また、接地導体間を接続している キャスタレーション5の数と位置及びスルーホール13 の数と位置も任意である。

【0035】図1、図2、図5の層間伝送線路18は全 ての金属導体層に接地導体を持つ伝送線路を用いてお り、構造がより同軸線路に近い構造であるため、良好な 高周波特性を実現しやすい。しかしながら、所望の高周 波特性が得られる範囲内で、マイクロストリップ線路等 の別の種類の伝送線路を用いても良く、また、多種類の 線路が混在していても構わない。

から成る場合を示したが、3層以上の多層から成る場合 であっても同様の効果が期待できる。さらに、誘電体材 料はセラミックに限るものではない。

【0037】以上説明したように、本発明により、リー ドレスチップキャリアの伝送線路の高周波特性が改善さ れ、プリント基板等との接続部にオープンスタブ構造を 生じないため、高周波特性の良好なリードレスチップキ ャリアを実現できる。

[0038]

【発明の効果】本発明の実施によって、優れた高周波特 10 性を有するリードレスチップキャリアを提供することが できる。

【図面の簡単な説明】

続部(拡大図)を示す。

【図1】本発明の第1の実施例を示す図であり、図中、 (a) はリードレスチップキャリアの上面図、(b) は 側面図、(c)は下面図、(d)は断面図(側面)、 (e)は層間金属導体層、(f)はプリント基板との接

【図2】本発明の第2の実施例を示す図であり図中、 側面図、(c)は下面図、(d)は断面図(側面)、 (e)は層間金属導体層を示す。

【図3】本発明の第3の実施例を示す図であり、図中、 (a) はリードレスチップキャリアの上面図、(b) は 側面図、(c)は下面図、(d)は断面図(側面)、 (e)は層間金属導体層を示す。

【図4】本発明の第4の実施例を示す図であり、図中、 (a) はリードレスチップキャリアの上面図、(b) は 側面図、(c)は下面図、(d)は断面図(側面)、 (e)は層間金属導体層を示す。

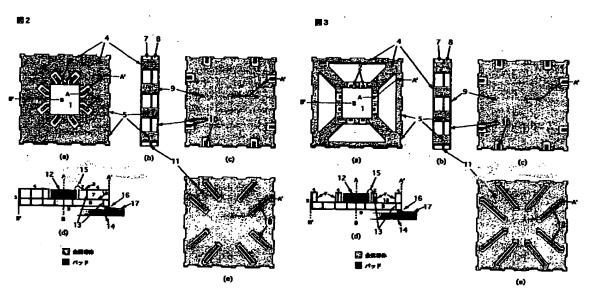
【図5】本発明の第5の実施例を示す図であり、図中、 (a) はリードレスチップキャリアの上層上面の金属導 体層、(b)は側面図、(c)は下面図、(d)は断面 図(側面)、(e)は層間金属導体層、(f)はシール リング、(g)は金属蓋を示す。

【図6】 従来の典型的なリードレスチップキャリアの構 造を示す図であり、図中、(a)はリードレスチップキ ャリアの上面図、(b)は側面図、(c)は下面図、 (d)は断面図(側面)、(e)は層間金属導体層、 (f)はプリント基板との接続部(拡大図)を示す。 【符号の説明】

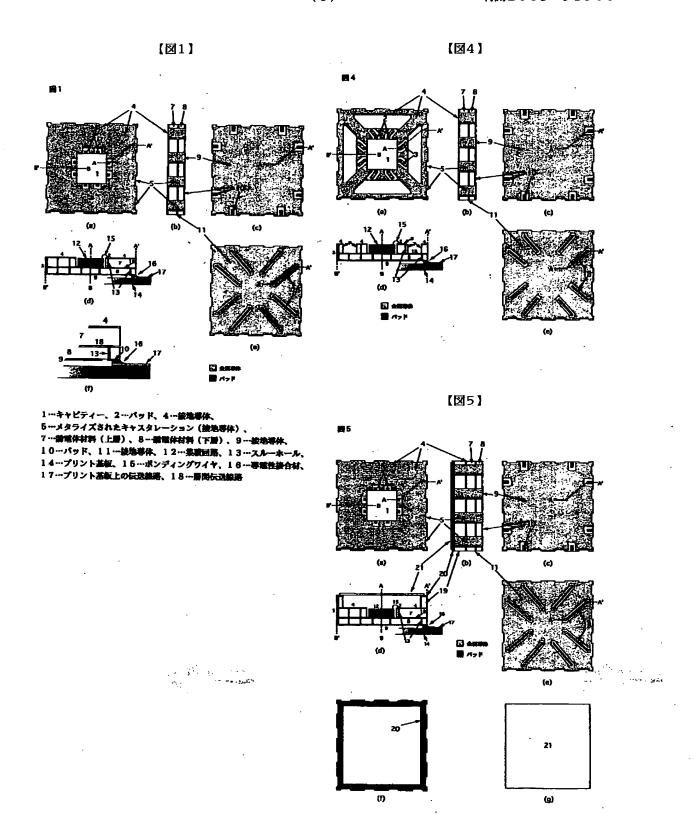
1…キャピティー、2…パッド、3…伝送線路、4…接 地導体、5…メタライズされたキャスタレーション (接 地導体)、6…メタライズされたキャスタレーション (伝送線路)、7…誘電体材料(上層)、8…誘電体材 (a)はリードレスチップキャリアの上面図、(b)は 20 料(下層)、9…接地導体、10…パッド、11…接地 導体、12…集積回路、13…スルーホール、14…プ リント基板、15…ボンディングワイヤ、16…導電性 接合材、17…プリント基板上の伝送線路、18…層間 伝送線路、19…蓋支持用誘電体層、20…シールリン グ、21…金属蓋。

【図2】

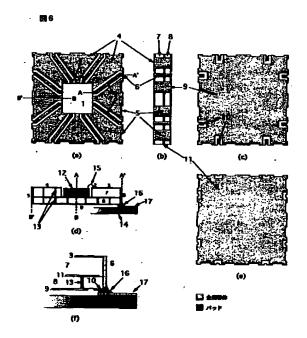
【図3】



3…伝送編集



【図6】



- 1…キャピティー、2…パッド、3…伝送線路、4…線地等体、
- 5…メタライズされたキャスタレーション(独地等体)、
- 6…メタライズされたキャスタレーション(伝送輸路)、
- 7…舒健体材料(上層)、8…静理体材料(下層)、9…接地導体、
- 10…パッド、11…接地事体、12…集積回路、13…スルーホール、
- 14…プリント基板、15…ポンディングワイヤ、16…専電性銀合材、
- 17…プリント基板上の伝送業務

フロントページの続き

(72)発明者 菅原 裕彦

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内